# (19)日本国特界庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平10-135498

(43)公開日 平成10年(1998) 5月22日

(51) Int.CL.\*

識別記号

Fi

H01L 31/04

C 2 3 C 14/06

H01L 31/04

C 2 3 C 14/06

客査請求 未請求 請求項の数9 FD (全 '6"頁)

(21)出顯番号

特顧平8-299791.

(22)出願日

平成8年(1996)10月25日

(71) 出題人 2000186913 ヤドウキュニー かいたまった これ かんてつ

昭和シェル石油株式会社

東京都港区台場二丁目3番2号

(72)発明者: 衛屋 勝巳

東京都千代田区麓が関3丁目2番5号 昭

和シェル石油株式会社内

(72) 発明者 田知行 宗頼

東京都千代田区麓が関3丁目2番5号。昭

和シェル石油株式会社内

(72) 発明者 加瀬 高久

東京都千代田区麓が関3丁目2番5号 昭

和シェル石油株式会社内

(74)代理人 弁理士 田中 康博

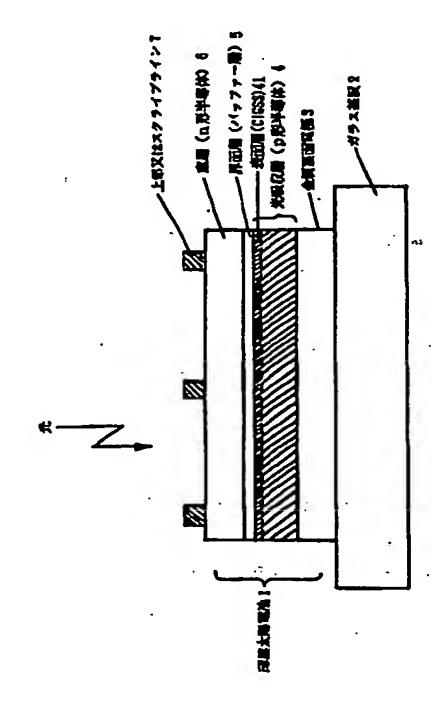
#### カルコパイライト系多元化合物半導体薄膜光吸収層 (54) 【発明の名称】 陽電池

からなる菩膜太

## (57)【要約】

開放電圧を大きくすると共に、界面層(又は 【課題】 バッファー層)と薄膜光吸収層との界面接合性をより良 好にする。

【解决手段】 金属裏面電極3、光吸収層4、界面層 5、窓層6及び上部電極7からなる薄膜太陽電池1がガ ラス基板2上に設けられている。 族太陽電池1の光吸収 層4に特徴を有し、光吸収層4を、p形のCu-III-VI: 族カルコパイライト構造のCu(InGa)Ser(CIGS) の薄膜と し、Gaの渡度を薄膜光吸収層表面から内部に向かって徐 々(段階的)に増加する濃度勾配にして開放電圧を大き くすると共に、前記光吸収層4の表面にCu(InGa)(SeS): (CIGSS) からなる極薄の表面層41を設け、このイオウ濃。 度を前記薄膜表面層41の表面(界面層側)から内部に向 かって急激に直線的に減少する濃度勾配にして界面接合 性を改善する。



#### 【特許請求の範囲】

1

【請求項2】 p形と反対の導電形を有し窓層として供される禁制帯幅が広くかつ透明で導電性を有する第2の金属酸化物半導体透明導電膜薄膜が、導電性を提供するためのホウ素(B)又はアルミニウム(Al)を含む酸化亜鉛からなることを特徴とする請求項1記載のカルコパイライト系多元化合物半導体薄膜光吸収層からなる薄膜太陽電池。

【請求項3】 前記薄膜光吸収層と前記窓層との界面に成長した透明で高抵抗を有する界面層(バッファー層)が、水酸基を含むII—VI族化合物半導体からなることを特徴とする請求項1記載のカルコパイライト系多元化合物半導体薄膜光吸収層からなる薄膜太陽電池。

【請求項4】 薄膜光吸収層として供される第1のCu
-III-VI:族カルコパイライト系多元化合物半導体薄膜
が、二セレン化銅インジウム・ガリウム(CIGS) 薄膜であることを特徴とする請求項1記載のカルコパイライト系
多元化合物半導体薄膜光吸収層からなる薄膜太陽電池。

【請求項5】 前記二セレン化銅インジウム・ガリウム (CIGS) 薄膜が、厚さ0.5~3ミクロンの薄膜であることを特徴とする請求項2記載のカルコパイライト系多元 化合物半導体薄膜光吸収層からなる薄膜太陽電池。

【請求項6】 薄膜光吸収層として供される第1のCu-III-VIi族カルコパイライト系多元化合物半導体薄膜が、表面層から金属裏面電極層間における(Ga+In) に対するGaの相対濃度が表面から内部に向かって徐々(段階的)に増加する濃度勾配であることを特徴とする請求項2記載のカルコパイライト系多元化合物半導体薄膜光吸収層からなる薄膜太陽電池。

【請求項7】 薄膜光吸収層として供される第1のCu-III-VIi族カルコバイライト系多元化合物半導体薄膜が、(Ga+In)に対するGaの相対濃度が、表面層から金属裏面電極層間では0.01~0.8で、且つ薄膜光吸収層表面から内部に向かって徐々(段階的)に増加する濃度勾配で、表面層側で0.01~0.7、金属裏面電極層側で0.2~0.8であることを特徴とする請求項2記載のカルコバイライト系多元化合物半導体薄膜光吸収

層からなる薄膜太陽電池。

【請求項8】 薄膜光吸収層として供される第1のCu-III-VIi族カルコパイライト系多元化合物半導体薄膜が、その表面に極薄膜の二セレン・イオウ化飼インジウム・ガリウム(CIGSS) からなる表面層を有することを特徴とする請求項2配載のカルコパイライト系多元化合物半導体薄膜光吸収層がらなる薄膜太陽電池。

【請求項9】 前記表面層が、その範囲が表面から15 00A以下で、且つそのイオウ濃度が、該表面層の表面 (界面層 (バッファー層) 側) から内部に向かって急放 に(直線的に) 減少する濃度勾配を有する組成物である ことを特徴とする請求項2記載のカルコバイライト系多 元化合物半導体薄膜光吸収層からなる薄膜太陽電池。 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、多元化合物半導体 薄膜を光吸収層として使用したヘテロ接合薄膜太陽電池、特に薄膜光吸収層としてCu-III-VIi族カルコパイライト系多元化合物半導体、例えば、ニセレン化銅インジウム・ガリウム (CIGS) のようなp形半導体の薄膜光吸収層とpnヘテロ接合を有する薄膜太陽電池に関する。

#### [0002]

【従来の技術】前記タイプの薄膜太陽電池は広範囲に実用化の可能性があり、その実用化の可能性について、米国特許第4,335,226 号明細書(Michelsen et.al.による、1982年 6月15日発行)に記載されている。

【0003】このような高い変換効率の薄膜太陽電池については、米国特許第4,798,660 号明細書 (J.H. Ermer et. al. による)、米国特許第4,915,745 号明細書 (G.A. Pollock et. al. による)、C.L. Jensen et. al. によるProceedings 23rd Photovoltaic Specialists Conference (1993) P.577 及び特別平4-326526号明細書 (光根他による)等に開示されている。

【0004】C.L. Jeasen et.al. による文献には、Gaを含んだCu-Ga 及びIn積層プリカーサー膜をセレン雰囲気中で熱処理することで光吸収層を作製した時に、Gaがモリブデン(Mo)金属裏面電極層側に偏析し、CIS 光吸収層と金属裏面電極層間の密着性を向上させると共に、オージェ電子分光法(AES)の結果より、作製した光吸収層が、Gaが濃度勾配を有するCu(InGa)Sex層とCIS 層の2層から成る内部構造を有する可能性が示唆されている。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】従来の多元化合物半導体薄膜を光吸収層として使用したヘテロ接合薄膜太陽電池においては、より一層の発電効率の向上及び界面接合特性の向上が望まれていた。本発明は、前配のような問題点を解消するためになされたもので、本発明の目的は、高い変換効率の達成と実用化という観点から重要な開放電圧の増大及び界面接合特性を向上することにあ

ろ。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、金属裏面電極層と、該金属裏面電極層上に設けられり形の導電形を有しかつ薄膜光吸収層として供される第1のCu-III-VII族カルコパイライト系多元化合物半導体薄膜と、前記薄膜光吸収層上に設けられり形と反対の導電形を有し窓層として供される禁制帯幅が広くかつ透明で導電性を有する第2の金属酸化物半導体透明導電膜薄膜と、前記第1のCu-III-VII族カルコパイライト系多元化合物半導体薄膜と第2の金属酸化物半導体透明導電膜薄膜の間の界面に成長した界面層(バッファー層)として供される透明で高抵抗を有する半導体薄膜とから構成される。

【0007】本発明は、p形と反対の導電形を有し窓層として供される禁制帯幅が広くかつ透明で導電性を有する第2の金属酸化物半導体透明導電膜薄膜を、導電性を提供するためのホウ素 (B) 又はアルミニウム (A-1) を含む酸化亜鉛からなるものにする。

【0008】本発明は、前記薄膜光吸収層と前記窓層との界面に成長した透明で高抵抗を有する界面層(バッファー層)を、水酸基を含むII—VI族化合物半導体からなるものにする。

【0009】本発明は、薄膜光吸収層として供される第 1のCu-III-VI・族カルコパイライト系多元化合物半導 体薄膜を、二セレン化銀インジウム・ガリウム(CIGS) 薄 膜にする。

【0010】本発明は、前記二セレン化銅インジウム・ガリウム(CIGS) 薄膜を、厚さ0.5~3ミクロンの薄膜にする。

【0011】本発明は、薄膜光吸収層として供される第1のCu-III-VI。族カルコパイライト系多元化合物半導体薄膜を、表面層から金属裏面電極層間における(Ga+In)に対するGaの相対濃度が薄膜光吸収層表面から内部に向かって徐々(段階的)に増加する濃度勾配にする。【0012】本発明は、薄膜光吸収層として供される第1のCu-III-VI。族カルコパイライト系多元化合物半導体薄膜を、(Ga+In)に対するGaの相対濃度が、表面層から界面層間では0.01~0.8で、且つ薄膜光吸収層表面から内部に向かって徐々(段階的)に増加する濃度勾配で、表面層側で0.01~0.7、界面層側で0.2~0.8にする。

【0013】本発明は、薄膜光吸収層として供される第 1のCu-III-VI 族力ルコパイライト系多元化合物半導 体薄膜を、その表面に極薄膜の二セレン・イオウ化銅インジウム・ガリウム(CIGSS) からなる表面層を有するものにする。

【0014】本発明は、前記表面層を、その範囲が表面から1500A以下で、且つそのイオウ濃度が、該表面を 層の表面(界面層(バッファー層)側)から内部に向か って急激に (直線的に) 減少する濃度勾配を有する組成物にする。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図1は本発明の薄膜太陽電池の概略構成を示す図である。薄膜太陽電池1は金属裏面電極層3、表面層41を有する光吸収層(p形半導体)4、界面層(バッファー層)5、窓層(n形半導体)及び上部電極(又はスクライブライン)7から構成されている。

【0017】金属裏面電極層3上に光吸収層4が設けられ、該光吸収層4として供される第1の半導体薄膜は、p形の導電性を有するCu-III-VIi族カルコパイライトが構造のニセレン化飼インジウム・ガリウム(CIGS)の厚さ1~3ミクロンの薄膜であり、前記薄膜光吸収層4は、III 族元素(GaやIn)の相対決度が、表面層から金属裏面電極層(Mo)間における(Ga+In)に対するGaの割合が0.01~0.8で、前配相対決度が、薄膜光吸収層表面から内部に向かって徐々(段階的)に増加する決度勾配であり、表面層側で0.01~0.7、金属裏面電極層(Mo)側で0.2~0.8であるような決度の制御がされたものであり、図2に示すようなGaの決度勾配を示す。

【0018】そして、前記光吸収層4の表面には極薄膜の表面層41が設けられており、該表面層41はニセレン・イオウ化銅インジウム・ガリウム(CIGSS) からなり、該極薄膜の表面層41の範囲は表面から15.00 A以下で、該表面層41のイオウ濃度が、前記薄膜表面層(CIGSS) の表面(界面層(バッファー層)側)から内部に向かって急激に(直線的に)減少する濃度勾配を有する組成物である。

【0019】更に、前記光吸収層4の上にバッファー層(界面層)5として供される透明で且つ高抵抗で、水酸化物を含んでも良いII-VI 族化合物半導体薄膜(例えば、Zn0、S)が形成され、その上に、窓層6として供されるn形の導電形を有する禁制帯幅が広く且つ透明で導電性を有する厚さ0.5~3ミクロンのB 又はAlを含んだZnOから成る第2の金属酸化物半導体透明導電膜薄膜が形成され、前配n形の導電形を有するZnOからなる窓層6の露出表面に上部電極又はスクライブライン7が必要に応じて形成された構造である。

【0020】 <u>国2</u>は、後述の製造方法により得られたCI GS薄膜光吸収層のGaの(Ga+In) に対する相対濃度分布をオージェ電子分光法(AES) により分析した分析結果を示したものである。

【0021】●は10重量%GaのCu-Ga 合金のターゲッ

ト及びInのターゲットを用いてスパッタリングして作製した、金属裏面電極層3からの順序がCu-Ga 合金層→純In層である積層プリカーサー膜を用いてセレン雰囲気中で熱処理して作製したCIGS薄膜光吸収層4である。

【0022】△は20重量%GaのCu-Ga 合金のターゲット及びInのターゲットを用いてスパッタリングして作製した、金属裏面電極層3からの順序が、Cu-Ga 合金層→純In層である積層プリカーサー膜を用いてセレン雰囲気中で熱処理して作製したCIGS薄膜光吸収層4である。

【0023】〇は30重量%GaのCu-Ga 合金のターゲット及びInのターゲットを用いてスパッタリングして作製した完金属裏面電極層3からの順序が、Cu-Ga 合金層→支票純In層である積層プリカーサー膜を用いてセレン雰囲気中で熱処理して作製したCIGS薄膜光吸収層4である。受力で表現して作製したCIGS薄膜光吸収層4である。受力で表現である。自己の主要を表現である。自己の主要を表現の薄膜光吸収層の禁制帯幅の構造の模式図を示す。本発明の薄膜光吸収層の禁制帯幅の構造の模式図を示す。本発明の薄膜光吸収層の整面に極薄膜のでIGSS 薄膜表面層41が形成されており、この極薄膜の表面層41は、イオウが前記薄膜表面層(CIGSS)の表面(界面層(バッファー層)側)から内部に向かって急激に(直線的に)減少する濃度勾配を有する組成物である。

【0025】図主に、前記図2の●印で示す、10重量%GaのCu-Ga 合金のターゲット及びInのターゲットを用いてスパッタリング法で作製した、金属裏面電極層3からの順序がCu-Ga 合金層→純In層である積層プリカーサー膜を用いてセレン雰囲気中で熱処理して作製したCIGS薄膜光吸収層4からなる薄膜太陽電池1のCu-Ga 合金ターゲットのGa含有量〔重量%〕に対する開放電圧V∞[mV]特性を示す。受光面積50cm²の薄膜太陽電池モジュールの、AM.1、5,100mV/cm²のソーラーシュミレーター下で得られたものであり、500mVを越える高い開放電圧V∞を得ることが可能となり、多結晶シリコン太陽電池と遜色ない結果が得られる。

【0026】その結果、薄膜光吸収層4のGaの濃度勾配が、図2の●印で示すような特性、即ち、表面から内部に向かって徐々(段階的)に増加する濃度勾配を有する組成とすることにより、禁制帯幅を広くすることが可能となり、開放電圧V∞を大きくすることができる。

【0027】窓5に、前記図2の△印で示す、20重量%GaのCu-Ga 合金のターゲット及びInのターゲットを用いてスパッタリングして作製した、金属裏面電極層3からの順序が、Cu-Ga 合金層→純In層である積層プリカーサー膜を用いてセレン雰囲気中で熱処理して作製したCI GS薄膜光吸収層4を有する薄膜太陽電池1において、前記CIGSS 表面層41がない薄膜太陽電池1と前記CIGSS 表

面層41がある薄膜太陽電池IIの曲線因子〔FF〕の測定 結果を示す。

【0028】前記測定結果のように、前記CIGSS 表面層41がある薄膜太陽電池IIは前記CIGSS 表面層41がない薄膜太陽電池Iよりも曲線因子 [FF] が大きくなることがわかった。

【0029】曲線因子 [FF] は太陽電池における界面接合特性の良否を判断する尺度であるので、本発明の光吸収層4の極薄膜の表面層41により、界面層(又はバッファー層)5と薄膜光吸収層4との界面接合特性を大幅に改善することができる。

[0030]

#### ・・【発明の効果】

- (A) 薄膜光吸収層4のGaの濃度勾配を、<u>気</u>室に示すように表面から内部に向かって徐々(段階的)に増加する内部構造とすることにより、禁制帯幅に勾配付けることが可能となり、開放電圧V∞を大きくすることができる。
- (B) 前記光吸収層4の極薄膜の表面層41は表面から1500A以下の範囲で、且つイオウ濃度が前記薄膜表面層(CIGSS)の表面(界面層(バッファー層)側)から内部に向かって急激に(直線的に)減少する濃度勾配を有する組成物であることにより、界面層(又はバッファー層)5と薄膜光吸収層4との界面接合性を改善することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の薄膜太陽電池の断面図である。

【図2】本発明の薄膜太陽電池のCIGS薄膜光吸収層のGa の(Ga+In)に対する相対濃度分布をオージェ電子分光法 (AES)により分析した結果を示す図である。

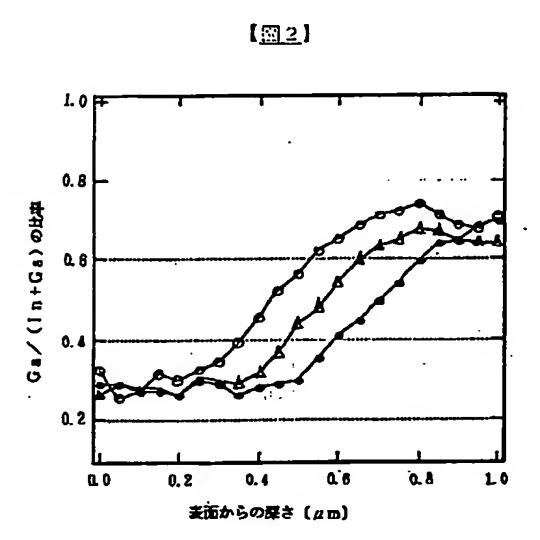
【<u>図3</u>】本発明の薄膜太陽電池の薄膜光吸収層の禁制帯幅の構造を示した模式図である。

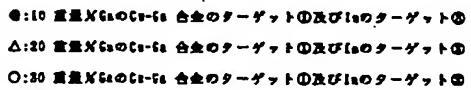
【図4】本発明のCIGS薄膜光吸収層からなる薄膜太陽電池のCu-Ga 合金ターゲットのGa含有量〔重量%〕に対する開放電圧Væ[mV]特性を示す図である。

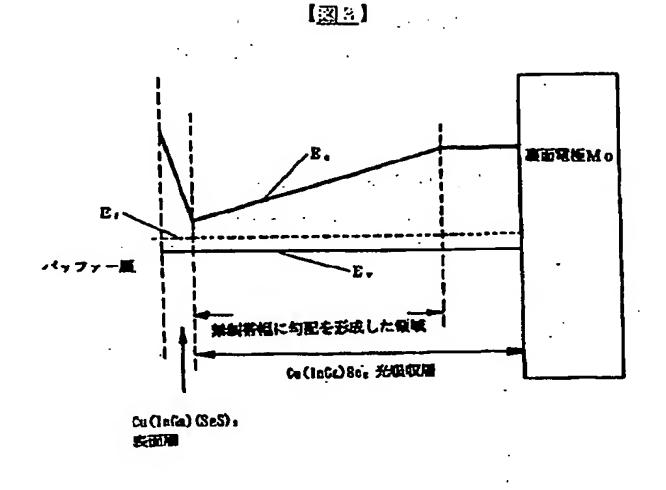
【図5】本発明のCIGSS 表面層がある薄膜太陽電池IIと、 CIGSS 表面層がない薄膜太陽電池Iとの曲線因子 [F / F]の測定結果を示す図である。

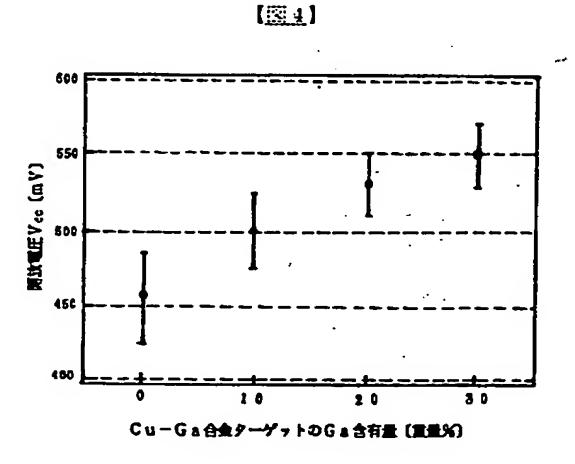
## 【符号の説明】

- 1 薄膜太陽電池
- 2 ガラス基板 \*\*\*
- 3 金属裏面電極
- 4 薄膜光吸収層 (p形半導体)
- 41 薄膜表面層 (CIGSS)
- 5 界面層(又はバッファー層)
- 6 窓層 (n形半導体)
- 7 上部電極又はスクライブライン

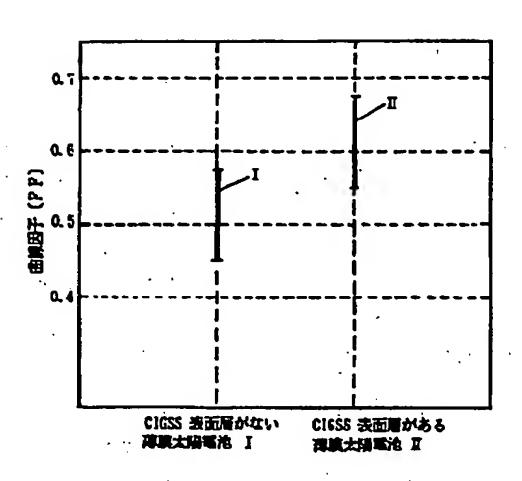








[25]



Ga含有量20重量%のCu-Gaターゲットを使用して作製した CIGS複模光級収益付薄膜太陽電法

-: